

5	<p>Комплекс оборудования для обработки оптического волокна, создания и исследования оптоволоконных компонентов: Лабораторный сварочный аппарат оптического волокна FSM-100P (Fujikura); Система для сварки и обработки оптического волокна LZM-100(Fujikura); Станция вытяжки оптического волокна/ответвителей CW-200B (Lightel); Сварочный аппарат и восстановитель защитного покрытия оптического волокна FSM-17S и FSR-02 (Fujikura); Рефлектометр высокого разрешения OBR 4600 (Luna Innovations); Анализатор оптического спектра (0,6–1,6 мкм) с источником белого света и измерителем мощности (до 30 Вт) AQ6370 (Yokogawa)</p>	3	5	5	5	5	0	4	5	4	4	0	3	2	0	0	0	3	2	1	1	3	5	0	0	5	5	0	1	4	5	5	5	4	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	42%
6	<p>Комплекс оборудования для микроструктурирования, модификации и анализа топологии и состава поверхности оптических материалов: Установка для прецизионного магнетронного осаждения металлов ATC-Z200H (AJA); Установка осаждения покрытий VSE-PVD-100-2 (Вакуумные системы и электроника) с оптической системой контроля Колибри-2 (ВМК "Оптоэлектроника"); Установка лазерной безмасковой фотолитографии DWL 66+Hires (Heidelberg); Круговая лазерная записывающая система ЛФП CLWS-300IAE (ИАиЭ СО РАН); Стенд для лазерной литографии X-Y ЛНЛ (ИАиЭ СО РАН); Установка реактивного ионного травления Plasmalab 80 Plus (Oxford Instruments); Лазерный интерферометр ФИЗО ФТИ-100PS-GbE-R (ИАиЭ СО РАН); Прибор для определения профиля поверхности на микро- и нано- масштабах (АСМ) с системой плазменной подготовки поверхности образцов; Атомно-силовой ближнепольный микроскоп Multi View 2000 (Nanonics); Спектральный эллипсометр Спектроскан (ИФП СО РАН); Микроскоп биологический лазерный сканирующий LSM 700 (Zeiss); Микроскоп оптический DM IRB (Leica); Микроскоп сканирующий электронный TM-3000 (Hitachi)</p>	3	5	5	5	5	0	3	5	5	0	3	2	0	0	0	3	2	1	1	3	4	0	0	5	5	0	1	4	5	5	5	4	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	42%
7	<p>Прибор для измерения показателя преломления, толщины слоев оптических структур на различных длинах волн: призмная измерительная система Metricon Model 2010/M</p>	3	5	5	5	5	0	2	5	4	0	3	5	0	0	0	3	2	1	0	3	3	3	0	0	5	5	5	1	4	5	5	5	4	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	42%

